

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005年1月27日 (27.01.2005)

PCT

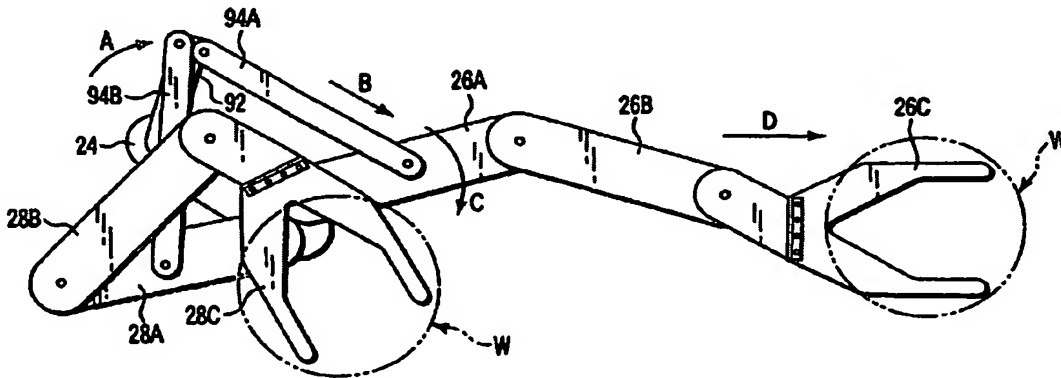
(10) 国際公開番号
WO 2005/008769 A1

- (51) 国際特許分類: H01L 21/68, (72) 発明者: および
B25J 9/06, I3/08, B65G 49/07 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 佐伯 弘
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/010178 明 (SAEKI, Hiroaki) [JP/JP], 石沢 繁 (ISHIZAWA,
(22) 国際出願日: 2004年7月9日 (09.07.2004) Shigeru) [JP/JP], 新藤 健弘 (SHINDO, Takehiro)
(25) 国際出願の言語: 日本語 [JP/JP], 広木 勲 (HIROKI, Tsutomu) [JP/JP], 町山 弥
(26) 国際公開の言語: 日本語 (MACHIYAMA, Wataru) [JP/JP].
(30) 優先権データ: (74) 代理人: 鈴江 武彦, 外 (SUZUYE, Takehiko et al.); 〒
特願2003-197689 2003年7月16日 (16.07.2003) JP 1000013 東京都千代田区蔵が関3丁目7番2号 鈴榮
特願2004-009506 2004年1月16日 (16.01.2004) JP 特許総合法律事務所内 Tokyo (JP).
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
[JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目3番6号 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
Tokyo (JP). DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PI, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,
(続業者)

BEST AVAILABLE COPY

(54) Title: TRANSPORTATION APPARATUS AND DRIVE MECHANISM

(54) 発明の名称: 搬送装置及び駆動機構



(57) Abstract: A transportation apparatus (20) for a substrate (W) to be treated includes a rotatable base (24). Bendable/stretchable first and second arm mechanisms (26, 28) are installed on the rotatable base. The first and second arm mechanisms respectively have, in that order from the rotatable base side, base end arms (26A, 28A), intermediate arms (26B, 28B), and picks (26C, 28C) that are pivotally connected to each other. The picks are arranged so as to support the substrate to be treated. A link mechanism (30) is connected to the base end arms of the first and second arm mechanisms so as to drive the first and second arm mechanisms. A first drive source (32) for driving and rotating the rotatable base is provided. A second drive source (34) for driving the link mechanism so as to bend and stretch the first and second arm mechanisms is provided.

(57) 要約: 被処理基板 (W) の搬送装置 (20) は、回転可能な回転基台 (24) を含む。回転基台に屈伸可能な第1及び第2アーム機構 (26、28) が取り付けられる。第1及び第2アーム機構の夫々は、回転基台側から順に互いに旋回可能に連結された基端アーム (26A、28A) と中間アーム (26B、28B) とピック (26C、28C) とを有する。ピックは被処理基板を支持するように配設される。第1及び第2アーム機構を駆動するように第1及び第2アーム機構の基端アームにリンク機構 (30) が連結される。回転基台を回転駆動するため、第1駆動源 (32) が配設される。第1及び第2アーム機構を屈伸させるようにリンク機構を駆動するため、第2駆動源 (34) が配設される。

WO 2005/008769 A1